DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2002 EPO. All rts. reserv.

12538174

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 7181414 A2 950721 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date JP 7181414 A2 950721 JP 93346285 A 931222 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date):

JP 93346285 A 931222

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 7181414 A2 950721

OPTICAL SCANNER (English)

Patent Assignee: OMRON TATEISI ELECTRONICS CO

Author (Inventor): TAKEMURA KENJI; GOTO HIROSHI; UMEDA HIDENOBU; IRIE ATSUSHI; YONEDA MASAHIRO; OKURA KIYOTOSHI; YAMANAKA NORIMASA; IKEDA MASAAKI

Priority (No, Kind, Date): JP 93346285 A Applic (No, Kind, Date): JP 93346285 A 931222

IPC: \* G02B-026/10

Language of Document: Japanese

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

### (11)特許出顧公開番号

# 特開平7-181414

(43)公開日 平成7年(1995)7月21日

(51) Int.Cl.6

識別配号

F I

技術表示箇所

G 0 2 B 26/10

101

特願平5-346285

(22)出願日

(21)出願番号

平成5年(1993)12月22日

審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 9 頁)

(71)出願人 000002945

オムロン株式会社

京都府京都市右京区花岡土堂町10番地

(72)発明者 武村 賢治

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72)発明者 後藤 博史

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72)発明者 梅田 秀信

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 才

ムロン株式会社内

(74)代理人 弁理士 中野 雅房

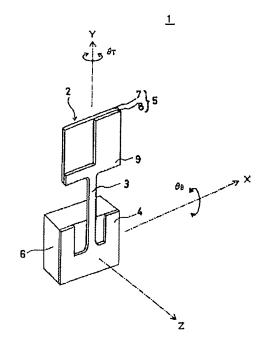
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 光スキャナ

#### (57)【要約】

【目的】 小型で、長寿命で、しかも低電圧で大きな走 査角度が得られる光スキャナを安価に提供する

【構成】 弾性変形部3と弾性変形部3の一端に設けら れた振動入力部4と、その他端に設けられたほぼ逆L字 状をしたミラー支持部8とからなるプレート9をベリリ ウム銅合金やステンレス鋼SUS631からプレス加工 等により一体として作成する。このとき、弾性変形部3 の厚さTと長さしの比し/Tをほぼ100≥し/T≥5 0、厚さTとその幅WをW≥Tとなるように作成する。 また、弾性変形部3と振動入力部4との接続部11及び 弾性変形部3とミラー支持部8との接続部11に、その 半径Rが1<R/W<2となるような略円弧状をしたコ ーナ10a、11aを設ける。ミラー支持部8にはミラ ー7を設け、振動入力部4には圧電素子のような駆動源 6を設けて光スキャナ1を作成する。



(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つの弾性変形モードを有す る弾性変形部と、前記弾性変形部の一端に設けられ、印 加された振動を前紀弾性変形部に伝える振動入力部と、 前記振動入力部の他端に設けられ、前記弾性変形部の弾 性変形モードに応じて回動するスキャン部と、前記振動 入力部に提動を印加する加振源とを備えた光スキャナに おいて、

前記弾性変形部の厚さTと前記弾性変形部の長さしの比 L/Tを、ほぼ

100≥L/T≥50

とすることを特徴とする光スキャナ。

【請求項2】 少なくとも1つの弾性変形モードを有す る弾性変形部と、前記弾性変形部の一端に設けられ、印 加された振動を前配弾性変形部に伝える振動入力部と、 前記振動入力部の他端に設けられ、前記弾性変形部の弾 性変形モードに応じて回動するスキャン部と、前記振動 入力部に振動を印加する加振源とを備えた光スキャナに おいて、

前記強性変形部と前記振動入力部との間の内隅部若しく 20 は前記弾性変形部と前記スキャン部との間の内隅部に略 円弧状のコーナを形成し、弾性変形部の幅Wと前記コー ナの半径Rの比R/Wを、

1 < R/W < 2

とすることを特徴する光スキャナ。

【請求項3】 少なくとも1つの弾性変形モードを有す る弾性変形部と、前記弾性変形部の一端に設けられ、印 加された振動を前記弾性変形部に伝える振動入力部と、 前記振動入力部の他端に設けられ、前記弾性変形部の弾 性変形モードに応じて回動するスキャン部と、前配振動 30 入力部に振動を印加する加振源とを傭えた光スキャナに おいて、

前記弾性変形部の前記振動入力部側の端部を前記加振源 の表面中央に位置させたことを特徴とする光スキャナ。

【請求項4】 少なくとも1つの弾性変形モードを有す る弾性変形部と、前記弾性変形部の一端に設けられ、印 加された振動を前記弾性変形部に伝える振動入力部と、 前記振動入力部の他端に設けられ、前記弾性変形部の弾 性変形モードに応じて回動するスキャン部と、前記振動 おいて、

少なくとも前記弾性変形部を銅合金やアルミ合金、チタ ン合金などの減衰係数の小さな金属材料により作成する ことを特徴とする光スキャナ。

【請求項5】 前記金属材料はベリリウム銅合金である ことを特徴とする請求項4に記載の光スキャナ。

【請求項6】 前記金属材料はステンレス網SUS63 1であることを特徴とする請求項4に記載の光スキャ ナ。

【請求項7】 前記金属材料は加工後の時効硬化処理の 50 すると、スキャン部55がheta7方向に回動する。しかし

不要な金属材料であることを特徴とする請求項4、5义 は6に記載の光スキャナ。

【請求項8】 少なくとも1つの弾性変形モードを有す る弾性変形部と、前記弾性変形部の一端に設けられ、印 加された振動を前記弾性変形部に伝える振動入力部と、 前記振動入力部の他端に設けられ、前記弾性変形部の弾 性変形モードに応じて回動するスキャン部と、前記振動 入力部に振動を印加する加振源とを備えた光スキャナに おいて、

.10 前記スキャン部を光ピーム反射用のミラー部と前記ミラ 一部の面積よりも小さな面積のミラー支持部とから構成 し、前記ミラー支持部を前記弾性変形部の一端に設けた ことを特徴とする光スキャナ。

【請求項9】 前記スキャン部の重心が前記弾性変形部 の中心軸から外れるように、前記ミラー支持部の形状を 前記中心軸に対して非対称としたことを特徴とする請求 項8に記載の光スキャナ。

【請求項10】 請求項1、2、3、4、5、6、7、 8又は9に記載の光スキャナにおいて、

前記弾性変形部の厚さTと前記弾性変形部の幅Wの関係 を

 $W \ge T$ 

とすることを特徴とする光スキャナ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光スキャナに関する。具 体的には、例えばレーザブリンタやバーコードリーダな どにおいて光を線状に走査させる光スキャナに関する。 [0002]

【従来の技術】光学部品の小型軽量化の要求に応じるた め、出願人は、単結晶シリコン基板をエッチングして作 製した小型軽量の振動子(縦横各15mm、厚さ0.1 5mm、重量0.08g) を圧電素子で共振させるよう にした超小型の2次元方向に走査可能な光スキャナを提 案した。

【0003】この従来例の光スキャナを図6及び図7に 示す。図6に示す光スキャナ51に使用される振動子5 2は、曲げ方向 (θ π 方向) 及びねじれ方向 (θ π 方向) に弾性変形モードを有する弾性変形部53の一端に振動 入力部に振動を印加する加振源とを備えた光スキャナに 40 入力部54を設け、他端に光ピーム反射用のスキャン部 55を設け、スキャン部55の片袖部にスキャン部55 の慣性モーメントを増大させるための慣性モーメント発 生翼56を形成したものである。この振動子52の振動 入力部54には圧電素子57が取り付けられており、弾 性変形部53の曲げ変形モードの共振周波数fsと等し い周波数の振動を圧電素子57から振動入力部54に印 加すると、スキャン部 5.5が $\theta$ 。方向に回動し、弾性変 形部53のねじれ変形モードの共振周波数 frと等しい 周波数の振動を圧電素子57から振動入力部54に印加

て、スキャン部55に光ビームを照射していると、反射 光が $\theta$ <sub>1</sub>方向もしくは $\theta$ <sub>1</sub>方向に走査される。

【0004】また、図7に示す光スキャナ61に使用さ れる振動子52のスキャン部55は、弾性変形部53の 軸心Pに対してほぼ左右対称な形状となっており、その 表面には鏡面加工されたミラー面58が形成され、裏面 の側端部には重り(偏心荷重)59が取り付けられてい る。したがって、図6に示す光スキャナ51の慣性モー メント翼56を除去した形状ものとなっていて、スキャ ン部55の大きさをできるだけ小さくして(例えば、縦 10 横各5mm以下)空気抵抗が十分無視できるようにされ ている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】これらの光スキャナ5 1、61に用いられる振動子52の材料として、主にS i(シリコン)やステンレス網SUS304が用いられ てきた。

【0006】Siは減疫係数が小さいので加振源つまり 圧電素子57に印加する電圧が低電圧でも大きな走査角 を得られるという利点を有するが、その反面Siを用い 20 て作成した振動子52にあっては、落下衝撃の際その衝 撃波などの影響のため、弾性変形部53の弾性限界内で あるにもかかわらず破壊してしまうという問題点があっ た。またSiウエハの材料費がステンレス鋼SUS30 4に比べて高いなどの問題点もあった。

【0007】一方SUS304は衝撃によっては破壊せ ず衝撃面では問題はないが、SUS304は減衰係数が Siに比べて大きいので、圧電素子57に大きな電圧を 印加する必要があり、電源の小型化、低消費電力化の点 で好ましくない。

【0008】また、SUS304は金属材料であるため 長期間の使用によって疲労破壊を生じるという問題点が あった。この点から、振動子52を高速で、かつ長期間 の使用にも耐えられるようにするには、走査角を減少さ せたり、振動子52を大型化したりしなければならない という問題点があった。この問題点について以下具体的 に説明する。

【0009】図8 (a) に示すものはSN曲線又はウェ ーラ曲線と呼ばれるものである。このSN曲線は、図8 (b) に示すように、例えば上記の振動子52のように 40 ある部分(弾性変形部53)に応力が繰り返し負荷され るような場合であって、上限応力を8:、下限応力を S<sub>2</sub>、Sm= (S<sub>1</sub>+S<sub>2</sub>) / 2を平均応力、Sa= (S<sub>1</sub> - S2) / 2を応力振幅として、平均応力Smが一定で ある場合に適用されるものであり、応力振幅Saを縦軸 に、その応力振幅Saのもとである部分が破壊するまで の応力繰り返し数Nを横軸(対数目盛り) にとって示し た図である。

【0010】振動子52の破壊は、図8 (a) のSN曲 線で表わされるように振動子52に生じる応力振幅Sa 50 形部と、前記**発性変**形部の一端に設けられ、印加された

と繰り返し回数Nで決まる。ここで、応力振幅Sa及び 繰り返し回数Nは、それぞれ次の①式及び②式で表わさ

 $Sa = \alpha \times T \times E \times \theta / I$ ····· ①

 $N = f \times t$ 

ここで、αは弾性変形部の断面形状によって決まる定 数、Tは弾性変形部の厚さ、Eは材料のヤング率、θは 振動子の走査角、Lは弾性変形部の長さ、fは駆動周波 数(振動子の共振周波数f)及びtは使用時間である。

【0011】また、振動子の共振周波数fは次の③式に よって表わされる。

 $f = \sqrt{(K/I)/2\pi} \dots (3)$ 

ここで、Kは振動子のパネ定数、Iは慣性モーメントで あって、Kは次の④式で表わされる。

 $K = \beta \times W \times T^{2} \times E / L$ なお、βは比例定数、Wは弾性変形部の幅である。

【0012】図8 (a) によれば、振動子を高速に (周 波数fを大きく)、かつ長時間(tを大きく)使用す る、つまり、大きな繰り返し回数Nで使用するために は、材料に負荷される応力振幅Saを小さくする必要が ある。ここで、応力振幅Saを小さくするためには、① 式からわかるように次の4つ方法が考えられる。

- 【0013】 (ア) 振動子の走査角 8 を小さくする。
- (イ) 弾性変形部の厚さTを薄くする。
- (ウ) 弾性変形部の長さしを長くする。
- (エ) ヤング率Eの小さな材料を使用する。
- 【0014】しかしながら、これらの方法を用いた場合 には次のような問題点を生じることになる。つまり、
- (ア) 振動子の走査角 を小さくすることは、光スキャ 30 ナの機能低下につながる。
  - (イ) 弾性変形部の厚さTを薄くすると、③式及び④式 からわかるように振動子のパネ定数Kが小さくなり、共 振周波数 f が著しく低下して、高速走査ができなくな る.
  - (ウ) 弾性変形部の長さしを長くすると、振動子が大き くかる.
  - (エ)ヤング率Eの小さな材料を小さくすると③式及び ④式からわかるように振動子のパネ定数Kが小さくな り、共振周波数 f が低下して高速走査ができなくなる。
  - 【0015】このように、高速にかつ長時間の使用(長 寿命化)は、以上の理由により走査角の減少を招き、光 スキャナの小型化に相反することになる。

【0016】本発明は叙上の従来例の欠点に鑑みてなさ れたものであり、その目的とするところは、小型で、長 寿命で、しかも低電圧で大きな走査角度が得られる光ス キャナを安価で提供することにある。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の光スキャ ナは、少なくとも1つの弾性変形モードを有する弾性変 振動を前配弾性変形部に伝える振動入力部と、前記振動 入力部の他端に設けられ、前記弾性変形部の弾性変形モ ードに応じて回動するスキャン部と、前記振動入力部に 振動を印加する加振源とを備えた光スキャナにおいて、 前記弾性変形部の厚さTと前記弾性変形部の長さしの比 レ/丁を、ほぼ

100≥L/T≥50

とすることを特徴としている。

【0018】本発明の第2の光スキャナは、少なくとも 1つの弾性変形モードを有する弾性変形部と、前記弾性 10 変形部の一端に設けられ、印加された振動を前配弾性変 形部に伝える振動入力部と、前記振動入力部の他端に設 けられ、前記弾性変形部の弾性変形モードに応じて回動 するスキャン部と、前配振動入力部に振動を印加する加 振顔とを備えた光スキャナにおいて、前記弾性変形部と 前記振動入力部との内隅部若しくは前記弾性変形部と前 記スキャン部との内隅部に略円弧状のコーナを形成し、 弾性変形部の幅Wと前記コーナの半径Rの比R/Wを、 1 < R/W < 2

とすることを特徴としている。

【0019】本発明の第3の光スキャナは、少なくとも 1つの弾性変形モードを有する弾性変形部と、前記弾性 変形部の一端に設けられ、印加された振動を前配弾性変 形部に伝える振動入力部と、前記振動入力部の他端に設 けられ、前記弾性変形部の弾性変形モードに応じて回動 するスキャン部と、前記振動入力部に振動を印加する加 **振源とを備えた光スキャナにおいて、前記弾性変形部の** 前記振動入力部側の端部を前記加振源の表面中央に位置 させたことを特徴としている。

【0020】本発明の第4の光スキャナは、少なくとも 30 1つの弾性変形モードを有する弾性変形部と、前記弾性 変形部の一端に設けられ、印加された振動を前記弾性変 形部に伝える振動入力部と、前記振動入力部の他端に設 けられ、前記弾性変形部の弾性変形モードに応じて回動 するスキャン部と、前記振動入力部に振動を印加する加 振源とを備えた光スキャナにおいて、少なくとも前記弾 性変形部を銅合金やアルミ合金、チタン合金などの減衰 係数の小さな金属材料により作成することを特徴として いる。特に、ベリリウム網合金やステンレス網SUS6 効硬化処理の不要な材料により作成するのが好ましい。

【0021】本発明の第5の光スキャナは、少なくとも 1 つの弾性変形モードを有する弾性変形部と、前記弾性 変形部の一端に設けられ、印加された振動を前記弾性変 形部に伝える振動入力部と、前記振動入力部の他端に設 けられ、前記弾性変形部の弾性変形モードに応じて回動 するスキャン部と、前記振動入力部に振動を印加する加 振源とを備えた光スキャナにおいて、前記スキャン部を 光ピーム反射用のミラー部と前記ミラー部の面積よりも 小さな面積の前記ミラー部を支持させるためのミラー支 50 ラー部を支持させるためのミラー支持部とから構成して

持部とから構成し、前記ミラー支持部を前記弾性変形部 の一端に設けたことを特徴としている。このとき、スキ ャン部の重心が弾性変形部の中心軸から外れるように、 前記ミラー支持部の形状を前記中心軸に対して非対称に 形成するのが望ましい。

【0022】上記の各光スキャナにあっては、前記弾性 変形部の厚さTと前記弾性変形部の幅Wの関係をWWT とするのがよい。

[0023]

【作用】本発明の第1の光スキャナは、弾性変形部の厚 さTとその長さLの比L/Tを、ほぼ100≥L/T≥ 50としたので、疲労強度に関係する応力振幅Saを低 く抑えつつ、共振周波数fに関係する振動子のパネ定数 Kを大きく維持し、しかも、弾性変形部の長さLを短く することができる。したがって、小型で、長寿命かつ高 速走査のできる光スキャナを提供することができる。

【0024】また、本発明の第2の光スキャナにあって は、弾性変形部と振動入力部の内隅部若しくは弾性変形 部とスキャン部の内隅部に略円弧状のコーナーを形成 し、弾性変形部の幅Wとこれらのコーナの半径Rとの比 R/Wを、1<R/W<2としているので、振動子に生 じる応力集中が緩和されて応力集中による破損が少なく なり、光スキャナの長寿命化を図ることができる。

【0025】さらに、本発明の第3の光スキャナにあっ ては、弾性変形部の振動入力部側の端部を加振源の表面 ほぼ中央に位置させたので、応力振幅Saや振動子のバ ネ定数Kに関係する弾性変形部の長さしを変えることな く、振動子の全長を短くでき、光スキャナを小型化する ことができる。

【0026】また、本発明の第4の光スキャナのよう に、少なくとも弾性変形部を銅合金やアルミ合金、チタ ン合金などの減衰係数の小さな金属材料から作成すれ ば、落下などの衝撃によっても振動子が破損されず、し かも小さな加振力でもって大きな走査角を得ることがで きる。このため、加振源を小型化し、加振源の低電圧化 を図ることができ、光スキャナの小型化、省電力化が容 易になる。

【0027】その中でも、銅合金のうち特にペリリウム 銅合金においては減衰係数が小さいだけでなく、疲労強 31により作成するのが好ましい。さらに、加工後の時 40 度も大きいので、光スキャナの長寿命化を図ることがで きる。さらに、これらの材料として、加工後の時効硬化 処理の不要な、例えば、ミルハードン材などを用いる と、加工後の熱処理で振動子が反るなどの変形の心配が なく、ばらつきの少ない振動子を提供することができ る。また、析出硬化系ステンレス鋼の一種であるSUS 631を用いても、ペリリウム鋼合金と同様な効果を得 ることができる。

> 【0028】本発明の第5の光スキャナにおいて、スキ ャン部をミラー部とミラー部の面積よりも小さな面積ミ

いるので、ミラー支持部をミラー部を支持できる最小の 形状で構成してスキャン部を軽量化し、振動子の慣性モ ーメントを低減することができる。したがって、共振周 波数fを大きくすることができ、高速走査ができる。こ のとき、スキャン部の重心が弾性変形部の中心軸から外 れるように、ミラー支持部の形状を非対称とすると、ね じれ変形させるために必要な偏心荷重が不要になり、部 品点数の減少ができコストダウンを図ることができる。

【0029】また、上記光スキャナにおいて、弾性変形 部の厚さTとその幅Wを、W≥Tとなるようにしている 10 ので、振動子は、加振方向と平行な軸回りには回転しに くくなり、必要な走査方向以外の不要な振動モードを低 減することができる。また、エッチングや放電加工、ブ レス加工などの方法によっても振動子を作成することが できるが、いずれの方法により作成しても、W≧Tの方 がW<Tに比べて製作精度がよく、特性の安定した振動 子が実現できる。

[0030]

【実施例】図1に本発明の一実施例による光スキャナ1 を示す。この光スキャナ1は、振動子2と圧電素子や磁 20 成されている。 歪振動子等の微小振動を発生する小形の駆動源6とから 構成されている。振動子2は、曲げ変形モードとねじれ 変形モードを有するトーションパー状の弾性変形部3の 一端に振動入力部4を設け、他端に弾性変形部3に支持 されたミラー支持部8と光源からの光ピームを反射させ るためのミラー7とからなるスキャン部5が設けられて いる。すなわち、振動子2は弾性変形部3と振動入力部 4とミラー支持部8とが一体として形成された薄板状の プレート9にミラー7が設けられたものである。ミラー 7は例えばシリコンウエハに鏡面加工を施して作成する 30 ことができ、シリコンウエハなどから作成することによ り慣性モーメントが小さくなり、高速走査が実現でき

【0031】図2(a)(b)は、それぞれプレート9 の左側面図および平面図であって、プレート9は銅合金 やアルミ合金、チタン合金などの減衰係数の小さな材料 からプレス加工等により蕁板状に作成されている。ま た、エッチングや放電加工により作成することもでき る。特に、ベリリウム銅合金やステンレス網SUS63 1より作成するのが望ましく、また時効硬化処理の不要 40 な例えばミルハードン材やテンションアニール材などを 用いるのが好ましい。このプレート9の少なくとも弾性 変形部3の厚さTは、弾性変形部3の幅Wよりも等しい か若しくは小さく(つまり、W≥T)なるように作成さ れている。また、弾性変形部3の長さLは、その長さL とその厚さTとの比L/Tが、ほぼ100≥L/T≥5 0となるように作成されている。さらに、弾性変形部3 の幅Wは厚さTと同じ寸法若しくは厚さT以上 (W≥ T) に作成されている。

ーメントを低減させるため、ミラー7を支持できる程度 に最小の形状に形成されていて、スキャン部5の重心が 振動子2の軸心Pから外れるように、軸心Pに対し非対 称な形状例えば、図2に示すようにほぼ逆L字状に形成 されている。これにより、従来の光スキャナ51に形成 されていた慣性モーメントを発生させるための慣性モー メント発生翼56や重り59を不要にすることができ る。また、ミラー支持部8と弾性変形部3との接続部1 0の内隅に略円弧状のコーナ10aを形成し、弾性変形 部3の幅Wと形成されたコーナ10aの半径Rとの比R /Wが、1<R/W<2となるように作成されている。

【0033】振動入力部4は、弾性変形部3と振動入力 部4との接続部11が駆動源6表面のほぼ中央付近に位 置するように形成されていて、駆動源6からの振動が振 助入力部4に効率よく入力されるよう凹状に形成されて いる。また、振動入力部4と弾性変形部3の他端との接 統部11の内隅にも略円弧状のコーナ11aを形成し、 形成されたコーナ11aの半径Rと弾性変形部3の幅W との比R/Wが、1<R/W<2となるようにように作

[0034] しかして、駆動源6により弾性変形部3の-曲げ変形モードの共振周波数 f®又は/及びねじれ変形 モードの共振周波数 frと等しい周波数の振動を振動入 力部4へ印加すると、弾性変形部3が当該弾性変形モー ドで振動し、スキャン部5を曲げ方向 ( $\theta$ )方向) 又は /及びねじれ方向(hetaτ方向)に回動させる。このと き、スキャン部5のミラー7に光ピームが照射されてい ると、反射された光ピームはスキャン部5の回動角の2 倍の走査角で走査される。

- 【0035】このような振動子2にあっては、弾性変形 部3の厚さTはその幅Wと比べてT≤Wの関係となるよ うに作成されているので、加振方向と平行な軸回り (Z 軸回り)には回転しにくくなり、必要な走査方向(heta。 方向及びθτ方向)以外の不要な振動モードを低減する ことができる。また、T≦Wの関係にしておくと、エッ チングや放電加工あるいはプレス加工によりプレート9 を作成する際、T>Wの関係に比べて加工精度を高くす ることができ、特性の安定した振動子2を作成すること ができる。
- 【0036】また、弾性変形部3の長さしと厚さての関 係を、ほぼ100≥レノT≥50となるように形成して いるので、弾性変形部3の長さしを短くして振動子2を 小型化でき、共振周波数 fa及びfrを上げることにより 高速走査が可能になる。さらに、応力振幅Saが小さく なるので長寿命化を図ることができる。つまり、弾性変 形部3の長さしと厚さTは、①式からわかるように振動 予2の応力振幅Saに関係するので、この点からすれ ば、L/Tは大きくする方が好ましく、L/T≥50く らいにするのがよい。一方、③式及び④式からわかるよ 【0032】ミラー支持部8は、スキャン部5の慣性モ 50 うに振動子2の共振周波数fa及びfrに関係するので、

この点からは、長さ上は短く、厚さ下は厚くして、L/Tを小さくする方が好ましく、100≥L/Tとするのがよい。したがって、長さLと厚さTの関係をほぼ100≥L/T≥50の範囲内に収まるようにすることにより、小型化、長寿命、高速走査の可能な振動子2を作成することができる。

【0037】さらに、振動入力部4と弾性変形部3の接続部11を駆動源6のほぼ中央に位置させるようにして形成しているので、同じ長さの弾性変形部3を有する振動子2に比べて、振動子2の全長を短くすることがで 10き、光スキャナ1を小型化することができる。

【0038】また、弾性変形部3とミラー支持部8若し くは弾性変形部3と振動入力部4との接続部10、11 の内隅に略円弧状のコーナ10a、11aを設け、弾性 変形部3の幅Wとそれぞれのコーナ10a、11aの半 径Rとの関係R/Wを、1<R/W<2としているの で、それぞれのコーナ10a、11aに発生する集中応 力が緩和され、振動子2 (プレート9) の破損を少なく することができる。つまり、振動子2が曲げ方向(heta $_{ extsf{1}}$ 方向) に変形した際、弾性変形部3と振動入力部4との 20 接続部11において最大応力が発生する。また、振動子 2 がねじれ方向 (θ:方向) に変形した際、弾性変形部 3と振動入力部4側との接続部11及び弾性変形部3と ミラー支持部8との接続部10において最大応力が発生 する。したがって、これらの接続部10、11において 路円弧状のコーナー10a、11aを設けることで集中 応力が緩和され、このとき1<R/W<2となるように コーナ10a、11aを形成するのが最も好ましい。

【0039】図3に示すものは、金属材料の強度(引張 強さ) と制振係数との関係を示す図である(金属材料便 30 覧より引用)。制振係数とは、金属材料の0.2%耐力 をσyとし、σy/10の表面最大せん断応力振幅を用い てねじり振動法で求めた非減衰能(SDC:specific d amping capacity) をいい、非減衰能SDC= (ΔW/ W) ×100 (%) で求められる。但し、Wは弾性エネ ルギー、ΔWは1サイクルあたりのエネルギー損失であ る。この制振係数が小さいほど振動は減衰しにくい。し たがって、青銅(図中の○1)や黄銅(図中の○2)な どの銅合金、アルミ合金(図中の○3)、チタン合金 (図中の○4) などは制振係数が小さく、すなわち、減 40 **袞係数の小さなこれらの材料によりプレート9を作成す** ることにより、小さな加振により大きな走査角が得ら れ、低電圧でもって駆動源6を駆動させることができ る。

【0040】図4には、ブレート9の材料としてシリコン及びベリリウム網合金を使用した光スキャナ1における駆動源6の加振量-走査角特性を測定した比較結果を示す。縦軸には光スキャナ1の走査角(度)を、横軸には加振量として駆動源6の変位量(μm)を表わしている。また、図4において実線はねじれ方向(01方向)

の走査角を、破線は曲げ方向( $\theta$ 1方向)の走査角を表わし、黒丸についてはベリリウム銅合金を使用した光スキャナについて測定したものを、白丸についてはシリコンを使用した光スキャナについて測定したものを表わしている。図4から分かるように、ベリリウム銅合金を使用してブレート9を作成すると、曲げ方向( $\theta$ 1方向)及びねじれ方向( $\theta$ 1方向)ともにシリコンを使用した場合に比べ、少ない駆動源6の変位量で大きな走査角を得ることができる。

10

【0041】次に、図5に2つの銅合金、すなわちベリリウム銅合金とリン青銅合金についてそれぞれのSN曲線を示す。図5から分かるように、同じ表面最大応力が加わった場合にはベリリウム銅合金(線イ)の方がリン青銅合金(線ロ)に比べてより多くの繰り返し回数に耐えることができ、疲労強度が大きい。したがって、ベリリウム銅合金を用いて振動子2(プレート9)を作成すれば、より長寿命の光スキャナ1を作成することができる。また、ステンレス網SUS631もベリリウム銅合金と同様に疲労強度が大きく、ステンレス網SUS631を用いてプレート9を作成することにより、光スキャナ1の寿命を延ばすことができる。

[0042] さらに、ブレート9は曲げ加工を必要としないので、ベリリウム網合金やステンレス網SUS631の中でも、あらかじめ時効硬化処理を施し高強度化してある材料、例えば、ミルハードン材やテンションアニール材を用いることができる。したがって、このような時効硬化処理を施した材料を用いることにより、ブレート9を加工したのちに熱処理を施す必要がなく、熱処理に伴う反りなどの変形を生じることがない。このため、精度よくブレート9を作成することができ、ばらつきの少ない光スキャナ1を提供することができる。

[0043]

【発明の効果】本発明の第1の光スキャナにあっては、 弾性変形部の厚さTと長さLの比L/Tを一定の範囲内 にすることで、小型で、長寿命かつ高速走査のできる光 スキャナを提供することができる。

[0044] また、第2の光スキャナにあっては、弾性変形部の幅Wと弾性変形部両端の振動入力部若しくはスキャン部との内隅部に形成した略円弧状のコーナの半径Rとの比R/Wを一定の範囲内にすることで、集中応力を緩和し、光スキャナの寿命を延ばすことができる。

[0045] 第3の光スキャナにあっては、弾性変形部の振動入力部側の端部の位置を加振源表面のほぼ中央に位置させることにより、弾性変形部の長さを変えることなく、光スキャナの小型化を図ることができる。

【0046】第4の光スキャナにあっては、少なくとも 弾性変形部を減衰係数の小さな金属材料で作成すること により、落下等の衝撃にも強く、小型で省電力化された 光スキャナを提供することができる。特に、ベリリウム 50 網合金、SUS631を用いて作成するのが望ましい。

11

このとき、時効硬化処理の不要な材料で作成すれば、ば らつきの少ない光スキャナを提供することができる。

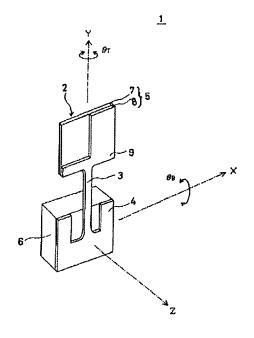
【0047】第5の光スキャナにあっては、スキャン部をミラー部と弾性変形部の一端に接続されたミラー部より小さなミラー支持部とより構成することにより、スキャン部の慣性モーメントを小さくして、高速走査を可能にすることができる。このとき、スキャン部の重心が光スキャナの中心軸から外れるように、ミラー支持部を形成させると、慣性モーメントを発生させるための重り等が不要になり、部品点数の削減、コストダウンを図るこ 10とができる。

【0048】上記の光スキャナにおいて、弾性変形部の幅Wを弾性変形部の厚さT以上とすることにより、不要な弾性変形モードの振動を少なくし、加工精度を向上することができ、精度よい光スキャナを提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である光スキャナを示す斜視 図である。

【図1】



12 【図 2】 (a) (b) はそれぞれ同上の光スキャナのプレートを示す左側面図及び平面図である。

【図3】金属材料の引張強度と制振係数との関係を示す 図である。

【図4】同上の光スキャナにおける駅動源の変位量と走 査角との関係を示す図である。

【図5】ベリリウム銅合金とりん青銅合金のSN曲線を示す図である。

【図6】従来例である光スキャナを示す斜視図である。

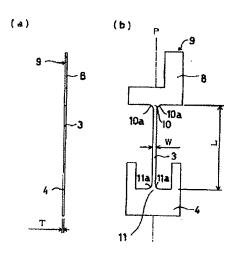
10 【図7】別な従来例である光スキャナを示す斜視図である。

【図 8】 (a) (b) は、S N曲線についての説明図である。

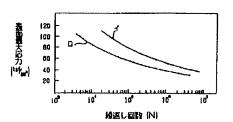
【符号の説明】

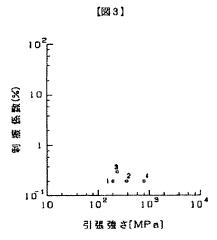
- 2 振動子
- 3 弹性变形部
- 8 ミラー支持部
- 10 弾性変形部とミラー支持部との接続部
- 11 弾性変形部と振動入力部との接続部

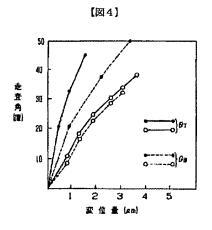
[図2]

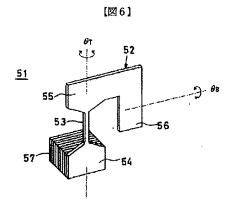


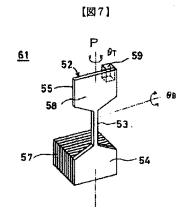
[図5]

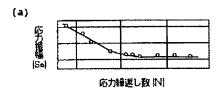




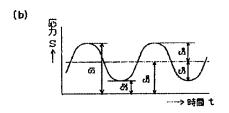








[図8]



### フロントページの続き

(72)発明者 入江 篤

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72)発明者 米田 国宏

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72)発明者 大倉 清俊

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72)発明者 山中 規正

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

(72)発明者 池田 正哲

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オ

ムロン株式会社内

·